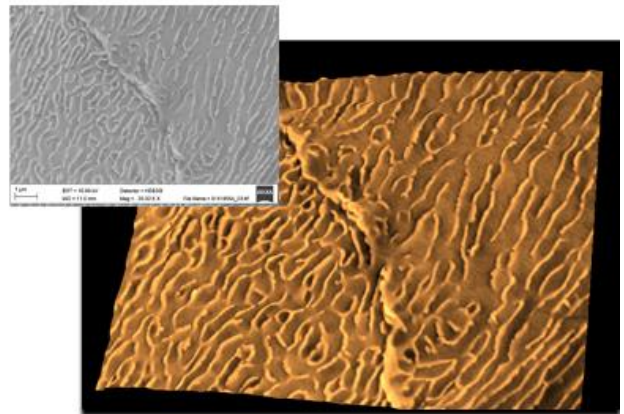
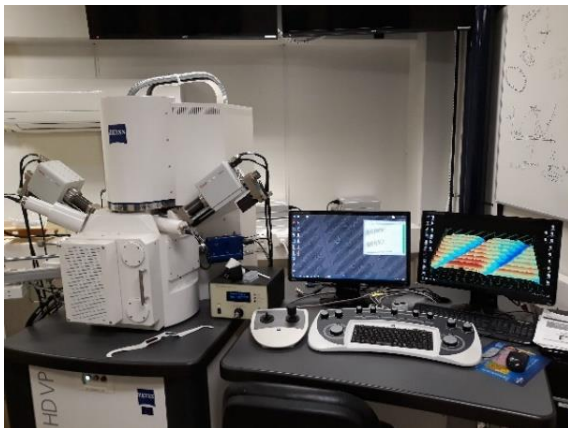


Pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM)

- Käytössämme on materiaalinäytteiden kuvaamiseen ja analysointiin soveltuva pyyhkäisyelektronimikroskoopi eli SEM (Carl Zeiss SigmaHD|VP).
- Kuvattavat näytteet voivat olla esimerkiksi jauhemaisia, ohut kalvoja, biologisia tai epäorgaanisia. Lisäksi näytekoko voi vaihdella yksittäisestä kiteestä aina lähes 5 cm korkeisiin ja 6,5 cm leveisiin kappaleisiin. Monipuolisia näytteenpitimiä erityyppisille näytteille.
- Kenttäemissioelektronitykillä varustetun mikroskoopin paikkaresoluutio on alle 1.2 nm ja se soveltuu myös sähköä johtamattomien näytteiden kuvaamiseen.
- Laite soveltuu pienten kohteiden tarkkaan kuvaamiseen ja sen suurennosalue on noin 50x - 500000x. Hiukkasten morfologia ja pintojen topologia ovat kuvattavissa. Näytteen pinnan 3D-rekonstruointiohjelmisto [1].



- SEM on varustettu kahdella EDS-detektorilla (Thermo Scientific) ja soveltuu myös nopeaan alkuaineanalyysiin.
- Raportointi sopimuksen mukaan.
- Asiakkaan on mahdollista kouluttautua kauttamme laitteen omatoimiseksi käyttäjäksi.

[1] MountainsMap 7 by Digital Surf Corp.

YHTEYSTIEDOT:

Jari T.T. Leskinen, FT

Itä-Suomen Yliopisto/ SIB Labs

Yliopistonranta 1 E

70211 Kuopio

p. 050-308 9945

<http://www.materiakeskus.fi>